

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局(43) 国際公開日
2005 年 6 月 2 日 (02.06.2005)

PCT

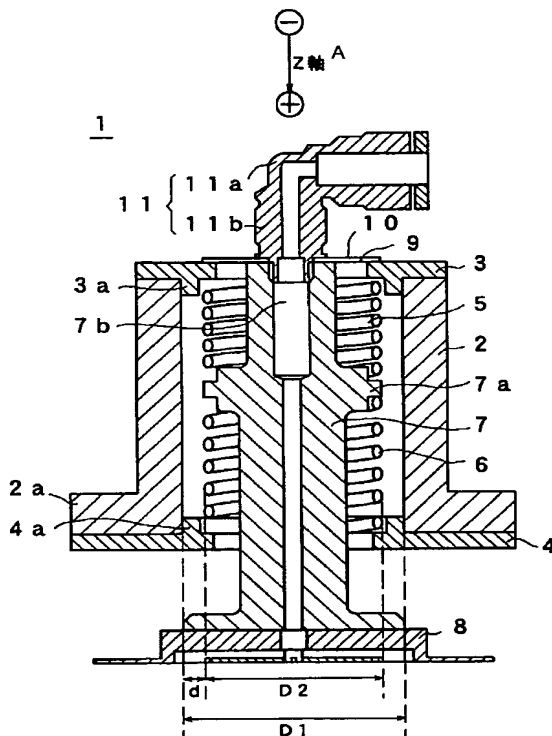
(10) 国際公開番号
WO 2005/049287 A1

- (51) 国際特許分類: B25J 19/00 (72) 発明者; および
(21) 国際出願番号: PCT/JP2004/017255 (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 西尾 仁孝
(22) 国際出願日: 2004 年 11 月 19 日 (19.11.2004) (NISHIO, Yoshitaka) [JP/JP]; 〒5640044 大阪府吹田市南金田 2 丁目 1 2 番 1 2 号三星ダイヤモンド工業株式会社内 Osaka (JP).
(25) 国際出願の言語: 日本語 (74) 代理人: 岡本宜喜 (OKAMOTO, Yoshiki); 〒5770066 大阪府東大阪市高井田本通 7-7-1 9 昌利ビル安田岡本特許事務所内 Osaka (JP).
(26) 国際公開の言語: 日本語 (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
(30) 優先権データ: 特願 2003-392157 2003 年 11 月 21 日 (21.11.2003) JP
(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 三星ダイヤモンド工業株式会社 (MITSUBOSHI DIAMOND INDUSTRIAL CO., LTD.) [JP/JP]; 〒5640044 大阪府吹田市南金田 2 丁目 1 2 番 1 2 号 Osaka (JP).

[続葉有]

(54) Title: VACUUM SUCTION HEAD, AND VACUUM SUCTION DEVICE AND TABLE USING THE SAME

(54) 発明の名称: 真空吸着ヘッド、その真空吸着ヘッドを用いた真空吸着装置及びテーブル



A... Z AXIS

(57) Abstract: A vacuum suction head capable of being used also for a large-sized liquid crystal display panel and capable of reliably sucking an object to be sucked even the object has undulation or flexure. The suction head has a shaft, the shaft holds a suction pad, and gas is charged into and discharged from the suction pad through a suction hole. A casing holds the shaft, through first and second springs, so as to be movable in the axial direction. Since the suction pad is elastically supported by the springs, the suction pad can reliably suck an object to be sucked having undulation or flexure. The vacuum suction head can be used for a vacuum suction device and a working table.

(57) 要約: 本発明の真空吸着ヘッドは、大型の液晶表示パネルにも適用でき、吸着対象物にうねりや撓みが存在しても、吸着対象物を確実に吸着することができる。吸着ヘッドにおいてシャフトを設け、吸着パッドを保持し、吸引孔を介して吸着パッド内の気体を給排気する。ケーシングは第1及び第2ばねを介して軸方向に対してシャフトを移動自在に保持する。吸着パッドはばねにより弾性的に支持されているので、うねりや撓みのある吸着対象物を確実に吸着することができる。この真空吸着ヘッドは真空吸着装置やワーキングテーブルに利用できる。



(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

- 国際調査報告書
- 補正書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。